ダイヤモンド光伝導素子の高効率化とその応用研究

電子工学専攻 米田研究室

永田 広明

1. 概要

テラヘルツ電磁波とは、周波数 1THz = 10¹²Hz、波長 300 µm 付近で、光と電波の境界に位置する電 磁波をいう(図1)。THz 帯の周波数の電磁波は、1980 年代に D.H.オーストンらのグループが光伝導素 子からの発生に成功して以来、ガリウム・ヒ素化合物による光伝導素子の研究など多くの研究がなされて いる[1]。最近では超短パルスレーザー技術の発達により、チタンサファイアレーザーなど安価で安定し た TW レベルの高強度の超短パルスレーザー光が得られるようになり、これをポンプ光とした非線形結 晶による差周波法による方法や半導体の表面準位を利用した方法、或いは光伝導素子を利用した方法など が研究されてきている。この THz 電磁波は長波長という特性を活かして近年、医療、非破壊検査、高速 通信などの多方面にわたる分野で科学的・技術的応用において関心が高まっており、特にガリウム・ヒ素 (GaAs)化合物を用いた光伝導素子は、高速化、高出力化が可能なことから THz 光源への応用が期待され ている[3]。本研究では、THz 電磁波の高出力化を目的としている。この目的に最も適応するものとして、 光伝導素子を用いる方法を選んでいる。



図1 THz 電磁波の属する周波数帯

光伝導素子から放射される THz 電磁波の強度は、ポンプ光照射によって半導体中に生成されたキャリ アによる電流(光伝導電流)の時間微分により決定される。光伝導電流は一般に、半導体内でのキャリア 濃度 n、ドリフト移動度 μ、印加電界強度 E を用いて、

J = ne µE

(1)

で表される。µE の値にはフォノンとのカップリングによって物質固有の飽和値があり、E の値はその物 質の絶縁破壊強度によって決定される。また、その高出力化には生成されたキャリアを効率よく加速させ ることが必要となる。THz 電磁波の出力強度のスケーリング則は(1.2)式で表される[4]。

$$E_{THz} = E_{bias} \frac{s \circ}{(1 + \sqrt{}) + s \circ}$$
(2)

ここで、E_{THz}は放射電界、Ebiasは印加電界強度で、s、oは表面光伝導度、自由空間のインピーダンス、は誘電率である。この式から、出力 THz 波は印加電界強度に比例し、印加電界と出力電界の

強度が等しくなった時点で飽和が起こることがわかる。高強度を得るためには、素子に印加する電界強度 を大きくすることが必要不可欠である。従来、光伝導素子としては前述のように GaAs が使用されてき たが、印加電界~放射電界で限界が来ることが提唱されている[3]。本研究では、THz 波放射源としてダ イヤモンドを使用している。ダイヤモンドには下記のように他の物質には類を見ない様々な物理的に優れ た特性を持っている。

- ・ バンドギャップエネルギーが大きい(5.5eV)
- ・ 硬い(機械的強度;例えばトンネル切削用のカッターの刃など)
- ・ 抵抗性が高い
- ・ 熱伝導性が良い(半導体用ヒートシンク、高出力赤外線用窓材)
- ・ 絶縁破壊強度(電界)が大きい

ここでダイヤモンドは 5.5eV とうバンドギャップがあるため、高出力紫外長短パルスレーザーを生成 する技術が必要である。チタンサファイアレーザーシステムでは基本波は赤外域にあるが、ピークパワ ーが高いため近年では LBO、BBO など非線形結晶の進歩により容易に 2 倍波、3 倍波を高効率で発生で き、紫外域の超短パルスレーザー光も安定に得られるようになった。ダイヤモンドを光伝導素子として 使用することにより、従来のガリウム・ヒ素基板に比べて 2 桁以上大きな印加電界強度を放射源上で実 現でき、これまでのところ、有効放射面積 10mm²から E=1 × 10⁵V/cm の電界強度で 10nJ、1.5ps の電 磁波の放射が確認されている。

ここで使用されたダイヤモンド素子は、平均粒径~10 μm というものであった。そこで、有効放 射面積を大きくし、より大きな出力を得るため、パルス幅~300fs、12mJ/pulse×6本というポンプ光を つくり、これまでの10mm²を10倍以上上回る128mm²という有効放射面積を高強度で励起することが 可能となった。この高電界印加ダイヤモンドとテラヘルツ波のコヒーレント加算を併せ持つ高出力化シス テムにより、これまでの10nJを大きく上回る100 μJ 程度のエネルギーを得られることが予想されてい る[4]。

これに加えて、(1)式における各パラメータを大きくすることで更に高強度の THz 電磁波を放出す ることを目指した。印加電界 E については上記方法により高強度化を試みたが、ドリフト移動度 µ及び キャリア濃度 n を次に述べる方法で大きくする。厚みを従来の 10 µm から 300 µm(平均粒径 150~200 µm)に増したダイヤモンド素子を使用した。粒径を大きくすることで移動度が大きくなる。次に、ダイ ヤモンド素子の厚みを増して粒界が大きくなったことで結晶性の向上により、最短波長超短パルスレー ザーである KrF レーザーの波長では素子の吸収率が低下するというデメリットを克服しなければならな い。そこで、(1)式中のキャリア濃度 n の値を大きくしたい。まず、2光子吸収を利用した。更に 不純物をダイヤモンド中にドープする。本研究では Li をドープさせ、キャリア生成効率の改善を行った。

2.移動度 µの向上



図2.移動度の粒径スケーリング

放射電磁波の強度は素子に流れる電流 J の時 間微分に比例しており、電流 J は、J = ne µE で表 されることは既に述べた。ここで、多結晶 C V D ダイヤモンドの場合、単結晶ダイヤモンドと違い 多結晶性からくる粒界(grain boundary)が存在す ることに注目しなければならない。ドリフト移動 度の粒径(grain size)依存性は図2(点線)のよう になっている。このグラフを式で表すと(3)式の ようになる。

$$\mu = \frac{30 \text{cm}^2}{\text{Vs}} \cdot (d/10 \mu \text{ m})^{0.43} \quad (3)$$

上式から、粒径が増すにつれてドリフト移動度が 大きくなることが明らである。粒径が小さくなる と粒界の影響が大きくなり、光伝導特性が低下す

ることによるものである。そこで、ダイヤモンド素子の厚みを増して粒径が従来の10 μmから150~200 μm程度として、ドリフト移動度μを大きくしたい。このダイヤモンド素子を用いて光伝導特性を測定 したのが図3である。

この図は、照射光強度を一定にして印加電界強 度を変化させたときに素子を流れる光伝導電流の 大きさの変化を測定した様子を表している。図か ら、 $E > 6 \times 10^4$ [V/cm]あたりで光伝導電流は飽和 している。ダイヤモンドの飽和ドリフト速度は V_{sat} = 2 × 10⁷ [cm/s]で、 μ E_{sat} = V_{sat}より、移動 度 μ は、 μ = V_{sat} / E_{sat} 330[cm²/Vs]となる。従 来使用された粒径~10 μ m のダイヤモンド(~ 30cm²/Vs)と比較して1桁改善されたといえる。

ここで、空気中の絶縁破壊強度が 10[kV/cm] であることを考慮すると、素子に高電界を印加す るのは困難になる。そこで、ダイヤモンド素子に



図3.光伝導電流の印加電界依存性

はアルミニウム電極をフォトエッチング技術により図4のように電極を施した。一方の面を+(プラ ス)極、もう一方を-(マイナス)極として電圧を印加する。各々の電極対にかかる電界の和をとる ことで、素子全体として大きな印加電界強度を得る。ここで、THz 電磁波を測定しようとする場合に は、隣り合うギャップには符号の異なる電界が印加されるため、遠視野領域では放射電界のキャンセ ルが起きてしまう。そのため、マスクをレーザー照射側に入れ、片側電界のみを放射に寄与させるよ うにする。



図4.ダイヤモンド THz エミッタの電極

次に、図4のように電極を施したことで、ダイヤモンド薄板の方向による粒界の影響を調べなけれ ばならない。そこで、図5、図6のような2つのサンプルを用意してそれぞれの光伝導特性を測定した。 結果は図7のようになり、各々のグラフがほぼ同一の直線上に乗っていることから、いずれの場合も 移動度は変わらず、方向による粒界の影響はないことが明らかとなった。







3.キャリア濃度 n の向上

これまで、移動度を大きくすることで光伝導電流を大きくし、THz 電磁波の放射強度を増すことを 考えてきた。しかし、粒径を大きくしたことで結晶構造が単純化したため、KrF レーザー光に対して その吸収効率が低下してしまう。また、ダイヤモンドの飽和ドリフト速度が V_{sat} = 2 × 10⁷ cm/s で制限 されてしまうため、移動度による THz 電磁波の高強度化には限界がある。そこで、更に高強度化を目 指すためにはダイヤモンド素子内部に生成するキャリアの量を多くすることが考えられる。

3.1 2光子吸収



図4のダイヤモンド素子において、印加電界強度を固定し、フィルタによりダイヤモンド表面に照射するポンプ光の強度を変化させて、そのときの光伝導電流の変化の様子を調べる。結果は図8のようになった。ここで、およそ4×10⁸W/cm²の照射光強度で非線形現象が起こっている。これは2光子吸収によるものであると考えられ、ダイヤモンドの光学的破壊限界(~10¹²W/cm²)を大きく下回る強度で2光子吸収を実現している。一般に光吸収において角振動数の光を吸収してト(ただし、ト=h/2

とする)だけエネルギーの高い状態に移るが、強 い光を用いた場合は₁、_{2、3}、・・、_nとい

うn個の光を同時に吸収してh(1+2+3+・・・+n)だけ高いエネルギー状態に遷移する場合があ り、このことを"多光子吸収"という。また、特にn=2の場合、"2光子吸収"と呼ぶ。その起こる確 率は2つの光の強度の積に比例する。

3.2 Li ドープによる吸収効率の改善

2 光子吸収では、照射する KrF ビーム強度をコントロールすることでフォトン キャリアへの変換 効率をアップさせた。今度は光伝導素子そのものを改良することで変換効率を向上させたい。そこで、

ダイヤモンド素子に不純物(Li)をドープさせた。 ドープの方法としてはまず、Li2O3の粉末をるつ ぼに入れ、その中にダイヤモンド薄板を埋める。 これを500の高温炉で約2日間加熱し、取出し たダイヤモンドを超音波で洗浄する。このような 方法でLiをドープしたダイヤモンドとドープし ていないものとで印加電界Eに対する光伝導電流 Jの変化の様子をグラフにしたのが図9である。 赤線がドープしたサンプル、緑線がドープしてい ないサンプルである。Liドープによって光伝導特 性は明らかに向上している。



図 9 .Li をドープしたダイヤモンドとドープして いないものの光伝導特性の比較

4.THz 電磁波の発生と観測

以上、粒径を大きくしたダイヤモンド薄板の光伝導特性を様々な観点から測定した結果、従来の薄 膜ダイヤモンドに比べて特性が向上しており、THz 電磁波の高強度化に期待を持てることがわかった。 発生した THz 電磁波の観測は、電気光学効果を利用し、ポンププローブ法で観測する。方法としては、 THz 電磁波を軸外し放物面鏡で集光させ電気光学結晶である ZnTe に入射させる。これをプローブ光で スキャンして THz 電磁波の時間波形を見る。



図10.THz 電磁波観測の光学系

5.まとめ、今後の課題

以上、見てきたとおり光伝導電流 J = ne μ E の式をベースとして各パラメータを大きくすることで ダイヤモンド素子の光伝導特性を向上させ、THz 電磁波の高強度化をする上でその方向性を確認できた。 今後は THz 電磁波の発生・観測を行うことが課題となる。また、更に有効放射面積を大きくし、より大 きな出力を得るため、パルス幅~300fs、12mJ/pulse × 6 本というポンプ光をつくるシステムの開発に より、これまでの 10mm²を 10 倍以上上回る 128mm² という有効放射面積を高強度で励起することが 可能となったことで、この高電界印加ダイヤモンドとテラヘルツ波のコヒーレント加算を併せ持つ高出 力化システムにより、これまでの 10nJ を大きく上回る 100 μ J 程度のエネルギーを得られること期待 できる。

参考文献

- [1] D.H.Auston, K.P.Cheung and P.R.Smith : Appl. Phys.Lett., 45, 284(1984)
- [2] 川瀬晃道ほか:パラメトリック発振による波長可変テラヘルツ電磁波の発生:レーザー研究(1998)
- [3]G.Rodriguez and A.J.Taylor : Opt.Lett.,vol.21,No.14,1046(1996)
- [4]Hitoki Yoneda, Kazutatsu Tokuyama, Ken-ichi Ueda, Hironori Yamamoto and Kazuhiro Baba : Appl.Opt.,vol.40, No36,6733(2001)